

Title (en)

PROCESS AND DEVICE FOR PROCESSING MATERIALS FROM WHICH METHANE AND OTHER CHEMICALS, BEING HARMFUL TO THE ENVIRONMENT, MAY ESCAPE.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEARBEITUNG VON MATERIALIEN, VON DENEN METHAN UND ANDERE UMWELTSCHÄDLICHE CHEMIKALIEN ENTWEICHEN KÖNNEN.

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES MATERIAUX A PARTIR DESQUELS LE METHANE ET D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, NOCIFS A L'ENVIRONNEMENT, PEUVENT S'ECHAPPER.

Publication

EP 0487574 A1 19920603 (EN)

Application

EP 90912224 A 19900815

Priority

NL 8902068 A 19890815

Abstract (en)

[origin: WO9102582A1] Process and device for processing materials from which methane and other chemicals, being harmful to the environment, may escape, e.g. for processing manure or sewage sludge. The starting material is heated and the escaping gases are subjected to a washing treatment with water or a circulating solution of a chemical washed out of the gas, e.g. ammonia. The methane in the gas escaping from the washing device is burned and the developed heat is, at least partly, utilized for heating the starting material.

Abstract (fr)

Procédé et dispositif destinés à traiter les matériaux, tels que le fumier ou la vase des eaux d'égout, à partir desquels le méthane et d'autres produits chimiques, nocifs à l'environnement, peuvent s'échapper. Le matériau de départ est chauffé et les gaz qui s'en échappent subissent un traitement par lavage à l'eau ou par une solution en circulation d'un produit chimique, tel que le gaz ammoniac, extrait des gaz lors du lavage. Le méthane qui se trouve dans le gaz qui s'échappe du dispositif de lavage est brûlé et la chaleur ainsi libérée est, au moins en partie, utilisée afin de chauffer le matériau de départ.

IPC 1-7

B01D 53/34

IPC 8 full level

B01D 53/52 (2006.01); **B01D 53/34** (2006.01); **B01D 53/58** (2006.01); **B01D 53/72** (2006.01); **B01D 53/77** (2006.01); **C02F 11/00** (2006.01);
C02F 11/04 (2006.01); **C05B 17/00** (2006.01); **C05F 3/00** (2006.01); **C05F 3/06** (2006.01)

CPC (source: EP KR)

B01D 53/34 (2013.01 - EP KR); **C02F 11/00** (2013.01 - EP); **C05B 17/00** (2013.01 - EP); **C05F 3/00** (2013.01 - EP); **Y02A 40/20** (2017.12 - EP);
Y02C 20/20 (2013.01 - EP); **Y02E 50/30** (2013.01 - EP); **Y02P 20/145** (2015.11 - EP); **Y02W 30/40** (2015.05 - EP)

C-Set (source: EP)

C05B 17/00 + C05D 3/02 + C05F 3/00

Citation (search report)

See references of WO 9102582A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9102582 A1 19910307; AU 6162490 A 19910403; CA 2064698 A1 19910216; CN 1050826 A 19910424; DD 298068 A5 19920206;
EP 0487574 A1 19920603; JP H04507217 A 19921217; KR 920703183 A 19921217; NL 8902068 A 19910301

DOCDB simple family (application)

NL 9000116 W 19900815; AU 6162490 A 19900815; CA 2064698 A 19900815; CN 90107583 A 19900815; DD 34344890 A 19900814;
EP 90912224 A 19900815; JP 51150290 A 19900815; KR 920700324 A 19920214; NL 8902068 A 19890815